



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISTITUTO DEI MATERIALI PER L'ELETTRONICA ED IL MAGNETISMO
Bando di gara - CIG 9919415037 - CUP B33C22000710006

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo del C.N.R., Parco Area delle Scienze 37A, 43124 Parma, protocollo.imem@pec.cnr.it, www.imem.cnr.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: Fornitura di un sistema di deposizione di film sottili per strati atomici assistito da plasma (Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition- PEALD), nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1, Progetto iENTRANCE@ENL - Codice NUTS ITH20 - Importo complessivo € 429.508,20 oltre IVA - CIG 9919415037

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Atti di gara su www.urp.cnr.it e su <https://gpa.appaltiamo.eu/>

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18.09.2023 ore 12:00. Prima seduta telematica: 18.09.2023 ore 14:00 mediante il sistema telematico GPA <https://gpa.appaltiamo.eu/>

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 11.08.2023

Il responsabile unico del procedimento
Dott. Andrea Zappettini